

## Fachverband Kurzzeitphysik (K)

Andreas Görtler  
Coherent GmbH  
Zielstattstr. 32  
81379 München  
andreas.goertler@coherent.com

### Übersicht der Hauptvorträge und Fachsitzungen

(Hörsaal 6E, Poster A)

#### Hauptvorträge

K 1.1	Mo	14:00–14:30	6E	<b>Laserstrahldiagnostik</b> — ●CARSTEN FISCHER
K 1.2	Mo	14:30–15:00	6E	<b>Höchstauflösende kurzzeitphotografische Diagnostik von Laserstrahlung-Materie Wechselwirkungsprozessen</b> — ●MANFRED HUGENSCHMIDT
K 5.1	Di	14:00–14:30	6C	<b>Bewegte Bilder auf atomarer Längen- und Zeitskala: Femtosekunden Röntgenbeugung</b> — ●MATIAS BARGHEER
K 6.1	Di	14:30–15:00	6E	<b>Rescheduled talk: High-Intensity Laser Ion Acceleration</b> — ●JÖRG SCHREIBER

#### Hauptvorträge des fachübergreifenden Symposiums SYBE

Siehe Abschnitt SYBE für das komplette Programm des Symposiums.

SYBE 1.1	Di	10:30–11:00	6A	<b>Immediate, Non-Physiological Responses of Mammalian Cells to Nanosecond Pulsed Electric Fields</b> — ●JÜRGEN F. KOLB, JODY A. WHITE, WOLFGANG FREY, SHAKA SCARLETT, RACHAEL SHEVIN, ANDREI PAKHOMOV, STEPHEN J. BEEBE, E. STEVE BUESCHER, PETER F. BLACKMORE, RAVINDRA P. JOSHI, RICHARD NUCCITELLI, KARL H. SCHOENBACH
SYBE 1.2	Di	11:00–11:30	6A	<b>Nanosekunden-zeitaufgelöste Messung der Membranaufladung biologischer Zellen in gepulsten elektrischen Feldern</b> — ●WOLFGANG FREY, THOMAS BERGHÖFER, JÜRGEN KOLB
SYBE 1.3	Di	11:30–12:00	6A	<b>Membran-Elektroporation – Konzept und Methode für Klinische Gen- und Krebs-Therapien</b> — ●EBERHARD NEUMANN, SERGEJ KAKORIN, THORSTEN GRIESE, KATJA TOENSING, ALINA FRANCESCU, GABRIEL FRANCESCU, UWE PLIQUETT
SYBE 1.4	Di	12:00–12:30	6A	<b>Keimabtötung mit hohen gepulsten elektrischen Feldern</b> — ●C. GUSBETH, W. FREY, H. VOLKMAN, S. GUPTA, H-J. BLUHM
SYBE 2.1	Di	14:00–14:30	6A	<b>Technische Elektroporation von Pflanzenzellen bei großen Massenströmen</b> — ●MARTIN SACK, RENÉ STÄNGLE, GEORG MÜLLER
SYBE 2.2	Di	14:30–15:00	6A	<b>Anwendung gepulster elektrischer Felder zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Lebensmittelindustrie</b> — ●STEFAN TÖPFL, VOLKER HEINZ
SYBE 2.3	Di	15:00–15:30	6A	<b>Zellarrays hergestellt durch Photo-induzierte Modifikation von Polymeren: Anwendung für Gen-Transfer durch reverse Transfektion und Elektroporation</b> — ●JOHANNES HEITZ, MICHAEL OLBRICH, ESTHER REBOLLAR, CHRISTOPH ROMANIN, IRENE FRISCHAUF, STEFFEN HERING, THOMAS PETERBAUER
SYBE 2.4	Di	15:30–16:00	6A	<b>Dekontamination durch Atmosphärendruckplasmen</b> — ●KLAUS-DIETER WELTMANN
SYBE 3.1	Di	16:30–17:00	6A	<b>Grundlagen und Anwendungen der Plasmasterilisation</b> — ●PETER AWAKOWICZ, HELMUT HALFMANN, NIKITA BIBINOV, ACHIM VON KEUDELL
SYBE 3.2	Di	17:00–17:30	6A	<b>Atmosphärendruck-Plasmajets für die Behandlung von empfindlichen Oberflächen</b> — ●V. SCHULZ-VON DER GATHEN, K. NIEMI, ST. REUTER, H.F. DÖBELE

## Hauptvorträge des fachübergreifenden Symposiums SYOH

Siehe Abschnitt SYOH für das komplette Programm des Symposiums.

SYOH 1.2	Mi	11:35–12:10	6A	<b>Beschichtung von Hochleistungsoptiken - Trends und Herausforderungen</b> — •NORBERT KAISER, ANDREAS TÜNNERMANN, MARTIN BISCHOFF, DIETER GÄBLER, OLAF STENZEL
SYOH 1.3	Mi	12:10–12:40	6A	<b>Herausforderungen an Design, Beschichtungs- und Meßtechnik bei der Umsetzung aktueller Anforderungen an die Dünnschichtoptik am Beispiel der Fluoreszenzmikroskopie</b> — •UWE SCHALLENBERG
SYOH 2.1	Mi	14:00–14:30	6A	<b>Herstellung optischer Hochleistungsschichten</b> — •HARRO HAGEDORN
SYOH 2.2	Mi	14:30–15:00	6A	<b>Hochpräzise Fertigung: In situ Monitorierung und Rugate-Filter</b> — •HENRIK EHLERS
SYOH 3.1	Mi	15:00–15:30	6A	<b>Optische Beschichtungen für Laseranwendungen</b> — •JOHANNES EBERT
SYOH 3.2	Mi	15:30–16:00	6A	<b>Quality Characteristics of Laser Optics</b> — •KAI STARKE, HOLGER BLASCHKE, LARS JENSEN, MARCO JUPÉ, PUJA KADKHODA, HEINRICH MÄDEBACH, DETLEV RISTAU
SYOH 3.3	Mi	16:30–17:00	6A	<b>Dispersive Spiegel für Femtosekunden-Laserquellen – Status und Trends</b> — •UWE MORGNER
SYOH 3.4	Mi	17:00–17:30	6A	<b>Innovatives Magnetronsputtern für die Lasertechnik</b> — •MICHAEL SCHERER
SYOH 4.1	Do	11:30–12:00	6A	<b>Optische Hochleistungsschichten für die Lithografieoptik</b> — •CHRISTOPH ZACZEK
SYOH 4.2	Do	12:00–12:30	6A	<b>XUV Multilayer Optiken</b> — •TORSTEN FEIGL, SERGIY YULIN, NICOLAS BENOIT, UWE DETLEF ZEITNER, THOMAS PESCHEL, CHRISTOPH DAMM, NORBERT KAISER, ANDREAS TÜNNERMANN
SYOH 5.1	Do	14:00–14:30	6A	<b>Optische Hochleistungsbeschichtungen in Excimer Lasern</b> — •CLAUS STROWITZI
SYOH 5.2	Do	14:30–15:00	6A	<b>Charakterisierung der Verlustmechanismen und der Strahlungsstabilität UV-optischer Materialien</b> — •KLAUS MANN
SYOH 6.1	Do	15:00–15:30	6A	<b>Herstellung und Anwendungspotenziale hochwertiger optischer Funktionsschichten durch Magnetron-Sputtertechnik</b> — •MICHAEL VERGÖHL, BERND SZYSZKA, CHRISTOPH RICKERS, ANDREAS PFLUG
SYOH 6.2	Do	15:30–16:00	6A	<b>Innovative stationary and in-line sputter technologies for precision optical coatings</b> — •PETER FRACH, HAGEN BARTZSCH, JOERN-STEFFEN LIEBIG, JOERN WEBER, VOLKER KIRCHHOFF

## Fachsitzungen

K 1.1–1.6	Mo	14:00–16:00	6E	<b>Laserstrahldiagnostik</b>
K 2.1–2.7	Mo	16:30–18:30	Poster A	<b>Poster I - Laseranwendungen</b>
K 3.1–3.6	Di	11:00–12:30	6E	<b>Laseranwendungen und Lasermaterialbearbeitung</b>
K 4	Di	12:30–13:00	6E	<b>Mitgliederversammlung</b>
K 5.1–5.1	Di	14:00–14:30	6C	<b>Gustav-Hertz-Preis (Preisträgervortrag, gemeinsam mit MO)</b>
K 6.1–6.2	Di	14:30–15:15	6E	<b>Kurzpulslaseranwendungen</b>
K 7.1–7.3	Di	15:15–16:00	6E	<b>Laserstrahlwechselwirkungen</b>
K 8.1–8.2	Di	16:30–17:00	6E	<b>Lichtquellen und Röntgenlaser</b>
K 9.1–9.4	Mi	16:30–17:30	6E	<b>Pulsed Power - Gasdynamik</b>
K 10.1–10.6	Mi	17:30–18:30	Poster A	<b>Poster II - Pulsed Power / Verfahren</b>

## Mitgliederversammlung des Fachverbands Kurzzzeitphysik

Dienstag 12:30–13:00 6E

- Bericht
- Tagungen 2008, 2009 etc.
- Wahlen
- Sonstiges